Ионный лазер на парах стронция в режиме многоволновой генерации

Г.Д. Чеботарев

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Проведены численные исследования зависимостей выходных характеристик ионного лазера на парах стронция от давления и температуры активной среды. Найден диапазон условий возбуждения активной среды для реализации многоволнового режима излучения на видимых и инфракрасных переходах иона стронция (λ=430,5; 416,2; 1091 и 1033 нм SrII). Результаты исследований обеспечивают возможность выбирать условия оптимального возбуждения многоволновых стронциевых лазеров, а также управлять относительным вкладом различных спектральных компонент в выходное излучение.

Ключевые слова: многоволновое излучение, рекомбинационная накачка, самоограниченный переход, лазер на парах стронция, численное моделирование.

Лазерное излучение в широком спектральном диапазоне может быть обеспечено лазерами на парах металлов [1-3]. Одним из представителей этого класса лазеров является лазер на парах стронция (ЛПС), который обладает высокими характеристиками генерации на рекомбинационных переходах в фиолетовой области спектра (λ =430,5 и 416,2 нм SrII – см. рис. 1) и перспективен для широкого ряда практических применений [4-6]. Особенность ЛПС состоит в возможности эффективной реализации как рекомбинационного, так и ионизационного механизма генерации. В частности, ЛПС эффективно излучает на самоограниченных переходах стронция в инфракрасной области спектра ($\lambda \sim 1$ мкм SrII, $\lambda \sim 3$ мкм SrI и λ =6,456 мкм SrI – см. рис. 1) [7-9]. Экспериментальные исследования [10-11] показали, что, несмотря на различие в механизмах генерации в видимой и инфракрасной областях спектра, в ЛПС возможен режим одновременной многоволновой генерации В широком спектральном диапазоне на рекомбинационных и самоограниченных переходах. При этом зависимости характеристик генерации на различных переходах в спектрах как SrII, так и SrI, от давления и температуры активной среды существенно различаются.

Поэтому реализация эффективного многоволнового режима генерации в ЛПС требует тщательного подбора условий возбуждения активной среды.

В работе численно исследованы зависимости выходных характеристик ионного ЛПС от давления и температуры активной среды, а также осуществлен поиск режимов накачки, при которых достигается эффективная многоволновая генерация на переходах λ =430,5; 416,2; 1091 и 1033 нм SrII.

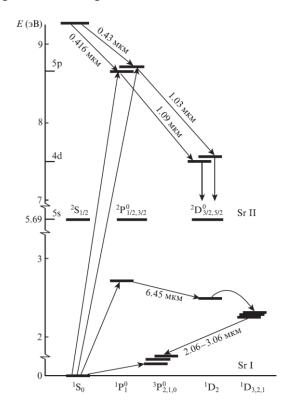


Рис. 1. – Упрощенная диаграмма уровней атома и иона стронция

При расчетах был использован метод численного моделирования ЛПС [12-14]. В частности, использовалась математическая модель ЛПС [15], включающая совместное описание электрической цепи возбуждения активной среды, газоразрядной плазмы в активном элементе и генерируемого излучения. Модель была протестирована с использованием результатов экспериментов [16-17] по измерениям параметров плазмы в активной среде ЛПС.

Численные эксперименты проводились для активных элементов ЛПС, исследованных ранее экспериментально в [10-11]. Как показали результаты экспериментальных исследований, предпочтительной схемой накачки многоволнового ЛПС является схема Блюмлейна [4-5], которая обеспечивает высокую крутизну переднего и заднего фронта импульса тока разряда.

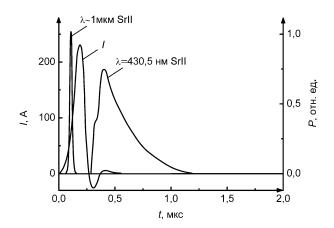


Рис. 2. – Осциллограммы импульсов тока и лазерного излучения на λ =430,5 нм и λ ~1 мкм SrII

Ha рис. 2 типичный ЛПС показан ДЛЯ многоволнового вид осциллограмм импульсов тока и лазерного излучения. Генерация на ИК переходах SrII осуществляется на переднем фронте импульса тока (см. рис. 2), когда в плазме реализуется ионизационная неравновесность. Генерация же в видимой области спектра происходит уже в период рекомбинационной неравновесности плазмы, имеющей место после окончания импульса тока. Заметим, что лазерные переходы $\lambda = 430,5$ и 416,2 нм SrII имеют общий верхний уровень (см. рис. 1) и являются конкурирующими компонентами дублета. По этой причине в спектре излучения обычно преобладает сильная компонента (λ =430,5 нм).

На рис. 3 приведены результаты моделирования для двух саморазогревных лазерных трубок ЛПС, имеющих одинаковую активную

длину l=50 см и отличающихся величиной внутреннего диаметра: d=1,1 см [10] и d=2,0 см [11].

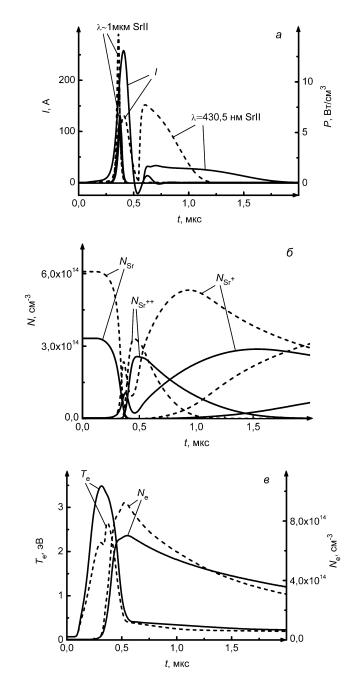


Рис. 3. — Результаты расчетов импульсов тока и лазерного излучения на переходах SrII (a), а также концентраций атомов, одно- и двукратных ионов стронция (δ), электронных концентрации и температуры (a) при условиях возбуждения, соответствующих экспериментам [10] (штриховые кривые) и [11] (сплошные кривые)

В частности, на рис. 3a представлены результаты расчетов импульсов тока и лазерного излучения на переходах SrII для условий, которые соответствуют экспериментам [10] (накопительные емкости в схеме Блюмлейна C=1650 пФ, давление гелия p_{He} =450 Тор) и [11] (C=1100 пФ, p_{He} =220 Тор). Эти результаты согласуются с осциллограммами на рис. 2. Заметим, что рассчитанные импульсы генерации на двух ИК линиях SrII, показанные на рис. 3a, практически совпадают друг с другом для обеих лазерных трубок.

На рис. 36,8 приведены результаты расчетов для концентраций атомов и ионов стронция (однократных и двукратных), а также для электронной концентрации $N_{\rm e}$ и температуры $T_{\rm e}$. Из рис. 36 следует, что за время импульса тока стронций в значительной степени дважды ионизуется в результате как прямой, так и ступенчатой ионизации электронным ударом. Этим обеспечивается интенсивная рекомбинационная накачка уровней SrII и лазерная генерация в послесвечении на переходе λ =430,5 нм SrII (см. рис. 3a). Скорость рекомбинационной накачки $W_{\rm r}$ сильно зависит от $T_{\rm e}$ ($W_{\rm r} \propto T_{\rm e}^{-9/2}$ [4-5]) и быстро «включается» в послесвечении по мере спада $T_{\rm e}$ (см. рис. 3a).

Лазерное излучение в ИК диапазоне (λ ~1 мкм SrII) имеет место на переднем фронте токового импульса (см. рис. 3a) и обусловлено быстрым возбуждением резонансных уровней иона стронция электронным ударом в условиях высоких значений T_e (см. рис. 3a).

Сопоставление приведенных на рис. 3 результатов двух численных экспериментов, осуществленных при существенно различающихся давлениях гелия, позволяет установить некоторые закономерности, свойственные активной среде ЛПС. В частности, видно, что с ростом p_{He} оптимальная начальная концентрация атомов стронция возрастает (см. рис. 36). При этом возрастают концентрации заряженных частиц в плазме (см. рис. 36,e), что

обеспечивается растущим удельным энерговкладом в разряд. Максимум электронной температуры во время импульса тока имеет значения в диапазоне $T_e \sim 2,5-3,5$ эВ и имеет тенденцию к снижению при высоких (см. рис. 3в). Температура давлениях гелия электронов послесвечении (в период излучения на λ =430,5 нм SrII) при увеличении давления остается на низком уровне $(T_e \sim 0.2 - 0.4 \text{ эВ})$, несмотря на рост рекомбинационного нагрева электронного газа, чему способствует ускорение охлаждения электронов (см. рис. 3e). Низкие значения $T_{\rm e}$, а также происходящий с ростом p_{He} рост концентраций ионов Sr^{++} и электронов, обуславливают рост скорости накачки $W_{\rm r}$ и импульсных энергетических характеристик генерации на рекомбинационных переходах SrII. При этом рост скорости рекомбинации заряженных частиц приводит к укорочению импульсов излучения в послесвечении (см. рис. 3a).

На рис. 4a приведены результаты численных расчетов зависимости средней мощности лазерной генерации $P_{\rm av}$ на переходах λ =430,5; 1033 и 1091 нм SrII от давления гелия для условий [10]. При расчетах для различных давлений производилась оптимизация температуры активного элемента (и, соответственно, концентрации атомов стронция, определяемой температурой внутренней стенки лазерной трубки), а также напряжения на емкостях C. Из результатов моделирования видно, что эффективная совместная видимая и ИК генерация на переходах SrII возможна в достаточно широком диапазоне давлений гелия.

Характер полученных при моделировании зависимостей $P_{\rm av}(p_{\rm He})$ соответствует экспериментальным данным [10] (см. рис. 4 δ). Из рис. 4 видно, что с ростом давления средняя мощность генерации на самоограниченных ИК переходах SrII снижается. Как показал анализ результатов моделирования, это обусловлено снижением $T_{\rm e}$ в импульсе тока и

соответствующим уменьшением скорости возбуждения резонансных уровней иона стронция за счет электронного удара.

Что касается видимого рекомбинационного перехода SrII, то вначале с ростом $p_{\rm He}$ имеет место рост мощности $P_{\rm av}$ (см. рис. 4), который обусловлен ростом скорости накачки $W_{\rm r}$, связанным с ускорением охлаждения электронов. Затем, при высоких давлениях рост средней мощности сменяется ее спадом (см. рис. 4), так как задний фронт импульса тока начинает ограничивать рост скорости охлаждения электронов.

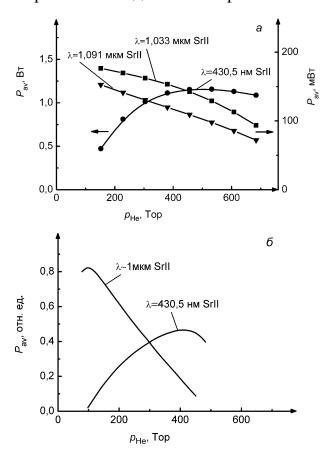


Рис. 4. – Зависимости мощности излучения на переходах SrII от давления: (a) – расчет, (δ) – эксперимент [10]

На рис. 5a приведены результаты численных расчетов зависимости средней мощности лазерной генерации $P_{\rm av}$ на переходах λ =430,5; 1033 и 1091 нм SrII от температуры активной зоны лазерной трубки для условий [11]. Из результатов моделирования следует, что имеется определенный

диапазон температур, в котором возможна совместная видимая и ИК генерация на переходах SrII.

Характер зависимостей $P_{\rm av}(T)$, полученных при моделировании, соответствует результатам эксперимента [11] (см. рис. 5 δ). Рост средней мощности, вначале наблюдаемый на всех переходах SrII при повышении температуры, обусловлен ростом скоростей накачки, связанным с повышением концентрации стронция.

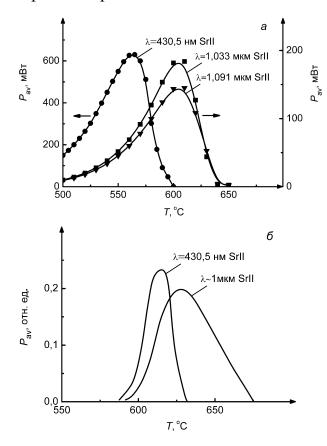


Рис. 5. – Зависимости мощности излучения на переходах SrII от температуры: (a) – расчет, (δ) – эксперимент [11]

Падение же мощности $P_{\rm av}$ на λ =430,5 нм SrII, наблюдаемое при превышении оптимальной для генерации температуры (см. рис. 5), связано с подъемом уровня $T_{\rm e}$ в послесвечении и соответствующим падением скорости рекомбинационной накачки. Подъем $T_{\rm e}$ при высоких температурах обусловлен снижением вклада ионов гелия в охлаждение электронного газа

из-за их замещения на ионы стронция, а также вследствие роста рекомбинационного нагрева электронного газа [5]. Падение средней мощности на λ ~1 мкм SrII, наблюдаемое при высоких температурах (см. рис. 5), связано со снижением $T_{\rm e}$ в импульсе тока, обусловленным ростом потерь энергии электронов на ионизацию стронция.

Таким образом, в работе проведены численные исследования зависимостей характеристик генерации ионного ЛПС от давления и температуры активной среды. Найден диапазон условий возбуждения активной среды для реализации многоволнового режима излучения на инфракрасных переходах иона стронция. Выявлен ряд видимых закономерностей, свойственных активной среде ЛПС, и установлены определяющие ИХ физические механизмы. Результаты исследований обеспечивают возможность выбирать условия оптимального возбуждения многоволновых ЛПС, а также управлять относительным вкладом различных спектральных компонент в выходное излучение.

Литература

- 1. Batenin V.M., Buchanov V.V., Boichenko A.M., Kazaryan M.A., Klimovskii I.I., Molodykh E.I. High-brightness Metal Vapour Lasers: Volume I: Physical Fundamentals and Mathematical Models. Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2016. 542 p.
- 2. Pulsed Metal Vapour Lasers / Ed. by Chris E. Little and Nicola V. Sabotinov. NATO ASI Series (1. Disarmament Technologies. V.5). Dortrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1996. 479 p.
- 3. Иванов И.Г., Зинченко С.П. Генерация лазеров на парах металлов с разрядом поперечного типа при высокой частоте повторения импульсов накачки // Инженерный вестник Дона, 2016, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3694.

- 4. Энциклопедия низкотемпературной плазмы / Под ред. Фортова В.Е. Том XI-4. Газовые и плазменные лазеры. Москва: Физматлит, 2005. 822 с.
- 5. Солдатов А.Н., Латуш Е.Л., Чеботарев Г.Д., Юдин Н.А., Васильева А.В., Полунин Ю.П., Пруцаков О.О. Импульсно-периодические лазеры на парах стронция и кальция. Томск: ТМЛ-Пресс, 2012. 526 с.
- 6. Фесенко А.А., Чеботарев Г.Д., Латуш Е.Л. Энергетические характеристики рекомбинационных He-Sr⁺ лазеров // Инженерный вестник Дона, 2007, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2007/30.
- 7. Петраш Г.Г. Импульсные газоразрядные лазеры // Успехи физических наук. 1971. Т. 105. С. 645-676.
- 8. Little C.E. Metal Vapour Lasers: Physics, Engineering and Applications. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapure: John Willey & Sons, 1999. 619 p.
- 9. Pan B.L., Chen G., Zhong J.W., Yao Z.X. Emission of laser pulses due to transitions from metastable to metastable levels in strontium vapor // Applied physics B: Lasers Opt. 2003. V. 76. N. 4. pp. 371-374.
- 10. Чеботарев Г.Д., Латуш Е.Л. Лазер на парах стронция в режиме совместной генерации на видимых и ИК переходах SrII и SrI // Электромагнитные волны и электронные системы. 2015. №6. С. 102-106.
- 11. Солдатов А.Н., Мирза С.Ю., Полунин Ю.П., Шумейко А.С. Импульсно-периодическая генерация лазера на переходах SrI и SrII с высоким коэффициентом усиления в условиях ионизационной и рекомбинационной неравновесности плазмы // Известия высших учебных заведений. Физика. 2013. Т. 56. №11. С. 66-71.
- 12. Carman R.J. A self-consistent model for a longitudinal discharge excited He-Sr recombination laser // IEEE J. Quant. Electron. 1990. V. 26. N. 9. pp. 1588-1608.

- 13. Carman R.J. A time-depended two electron group model for a discharge excited He-Sr recombination laser. // J. Phys. D. 1991. V. 24. pp. 1803-1810.
- 14. Chen Li, Mao BangNing, Wang YuBo, Wang LiMing, Pan BaiLiang. A kinetic model for alternate oscillation of self-terminating and recombination lasers in strontium ions. // Optics Communications. 2008. V. 281. pp. 1211–1216.
- 15. Chebotarev G.D., Prutsakov O.O., Latush E.L. Mathematical modeling of ion recombination strontium vapour laser // Proceedings of SPIE. 2004. V. 5483. pp. 83-103.
- 16.Künnemeyer R., McLucas C.W., Brown D.J.W., McIntosh A.J. Timeresolved measurements of population density in a Sr⁺ recombination laser. // IEEE J. Quant. Electron. 1987. V. 23. N. 11. pp. 2028-2033.
- 17.Loveland D.G., Webb C.E. Measurement of the electron density in a strontium vapour laser. // J. Phys. 1992. V. 25. pp. 597-604.

References

- 1. Batenin V.M., Buchanov V.V., Boichenko A.M., Kazaryan M.A., Klimovskii I.I., Molodykh E.I. High-brightness Metal Vapour Lasers: Volume I: Physical Fundamentals and Mathematical Models. Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2016. 542 p.
- 2. Pulsed Metal Vapour Lasers. Ed. by Chris E. Little and Nicola V. Sabotinov. NATO ASI Series (1. Disarmament Technologies. V.5). Dortrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1996. 479 p.
- 3. Ivanov I.G., Zinchenko S.P. Inzhenernyj vestnik Dona, 2016, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3694.
- 4. Entsiklopediya nizkotemperaturnoy plazmy [Encyclopedia of Low-Temperature Plasma]. Pod red. Fortova V.E. Tom XI-4. Gazovye i plazmennye lazery [Gas and plasma lasers]. Moskva: Fizmatlit, 2005. 822 p.
- 5. Soldatov A.N., Latush E.L., Chebotarev G.D., Yudin N.A., Vasil'eva A.V., Polunin Yu.P., Prutsakov O.O. Impul'sno-periodicheskie lazery na parakh

- strontsiya i kal'tsiya [Repetitively pulsed strontium and calcium vapor laser]. Tomsk: TML-Press, 2012. 526 p.
- 6. Fesenko A.A., Chebotarev G.D., Latush E.L. Inzhenernyj vestnik Dona, 2007, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2007/30.
 - 7. Petrash G.G. Sov. Phys. Usp. 1972. V. 14. pp. 747-765.
- 8. Little C.E. Metal Vapour Lasers: Physics, Engineering and Applications. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapure: John Willey & Sons, 1999. 619 p.
- 9. Pan B.L., Chen G., Zhong J.W., Yao Z.X. Applied physics B: Lasers Opt. 2003. V. 76. N. 4. pp. 371-374.
- 10. Chebotarev G.D., Latush E.L. Electromagnetic Waves and Electronic Systems. 2015. № 6. pp. 102-106.
- 11. Soldatov A.N., Mirza S.Yu., Polunin Yu.P., Shumeiko A.S. Russian Physics Journal. 2014. V. 56, N. 11. pp. 1281-1286.
 - 12. Carman R.J. IEEE J. Quant. Electron. 1990. V. 26. №. 9. pp. 1588-1608.
 - 13. Carman R.J. J. Phys. D. 1991. V. 24. pp. 1803-1810.
- 14. Chen Li, Mao BangNing, Wang YuBo, Wang LiMing, Pan BaiLiang. Optics Communications. 2008. V. 281. pp. 1211–1216.
- 15. Chebotarev G.D., Prutsakov O.O., Latush E.L. Proceedings of SPIE. 2004. V. 5483. pp. 83-103.
- 16. Künnemeyer R., McLucas C.W., Brown D.J.W., McIntosh A.J. IEEE J. Quant. Electron. 1987. V. 23. N. 11. pp. 2028-2033.
 - 17. Loveland D.G., Webb C.E. J. Phys. 1992. V. 25. pp. 597-604.